

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【公開番号】特開2004-349696(P2004-349696A)
【公開日】平成16年12月9日(2004.12.9)
【年通号数】公開・登録公報2004-048
【出願番号】特願2004-145277(P2004-145277)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/02 Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月14日(2007.5.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体製造ツールをテストするために使用したテスト基板を再生利用する方法であって

、
複数のテスト基板から複数のテスト基板の識別データを読み取るステップと、
各々の読み取られたテスト基板に対して、各々の読み取られたテスト基板を再生利用するために選択された再生利用プロセスを識別する、ストアされた再生利用プロセスの識別データをデータベースから得るステップと、
を有することを特徴とする方法。